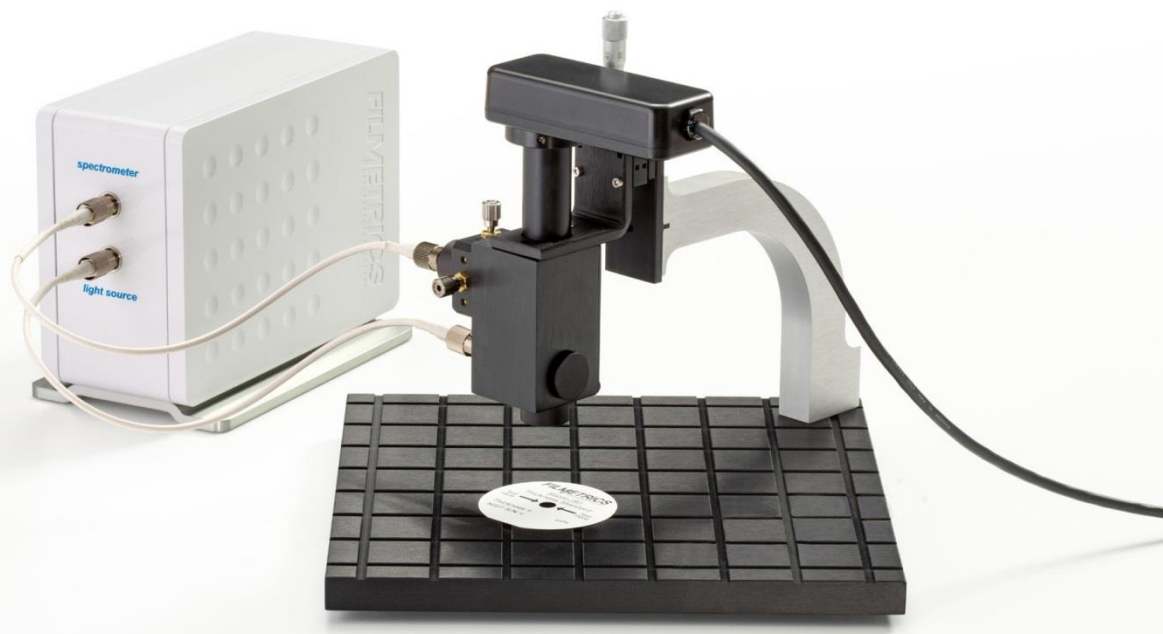


# F3-XXT

## 薄膜厚度测量仪



选配摄像功能的 F3-XXT

### 测量厚度最大到 3 毫米的先进薄膜厚度测量系统

对于大多数的膜厚测试系统来说，当厚度大于 100 微米后都变得非常困难。那是因为他们是通过反射率振幅干涉的光谱频率来算薄膜的厚度，会导致干涉频率超过光谱的分辨率。

为了克服这个问题，F3-XXT 配备 Filmetrics 自主研发的光谱仪，材料达到 3 毫米厚度，它可以很好测量。引用特殊的光学配件，使光斑尺寸不到 25 微米，使得即使是较高粗糙度和不均匀性的材料都可以测量。

几乎所有的半导体和介质材料都可以很好非常迅速的测试，并且在不到一秒钟的时间就可以将数据输出。

### Filmetrics 优势

- 桌面型薄膜厚度测量的全球领导者
- 24 小时电脑、Email、在线支持
- 直观的分析软件

### 附加特性

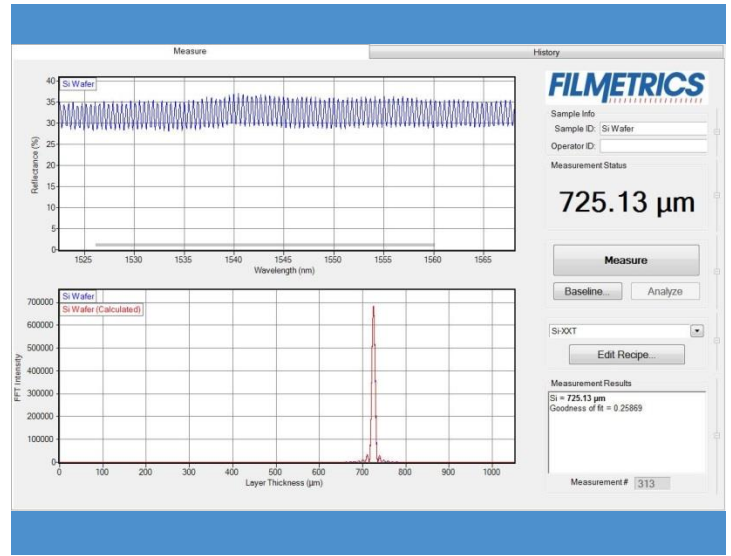
- 嵌入式在线诊断方式
- 免费离线分析软件
- 精细的历史数据功能，帮助用户有效的存储，重现与绘制测试结果

### 相关应用

- 硅片厚度
- 光刻胶厚度（如 SU-8 胶）
- 集成电路故障分析
- 玻璃和塑料板材

# F3-XXT

## 薄膜厚度测量仪



选配 XY8 平台和自动聚焦的 F3-XXT

### 厚度 (需选配 UPG-RT-to-Thickness)

测量范围:	10 µm - 3 mm (低折射率膜层) 5 µm - 1 mm (硅)
准确度 <sup>1</sup> :	较大者 0.4% 或 50 nm
精度 <sup>1</sup> :	5 nm
稳定性 <sup>1</sup> :	5 nm
测量时间:	<0.1 秒
最大粗糙度 <sup>2</sup> :	30 µm 研磨-抛光
数据记录:	自动设定
数据导出:	标准 Windows 方式
软件可操作性	可通过 .NET 扩展

### 自动化 XY8 图案平台配件

最大芯片尺寸:	38 mm x 38 mm
移动速度:	6 mm/sec
定位重复性 <sup>3</sup> :	10 µm
自动聚焦:	选配

### 基本要求

斑点尺寸	<25 µm
样品尺寸:	1 mm - 300 mm 直径或更大
光源平均故障间隔时间:	>10 年
电源:	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 0.3 - 0.1 A

### 电脑要求

接口:	USB 2.0
-----	---------

### 操作系统

PC:	Windows XP(SP2) - Windows 8(64-bit)
Mac:	OS X Lion/Mountain

- <sup>1</sup> 取决材料
- <sup>2</sup> 在 200 µm 厚度样品上
- <sup>3</sup> 包括模具边缘



优尼康科技有限公司

– Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改, 恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc